(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-140563

(43)公開日 平成6年(1994)5月20日

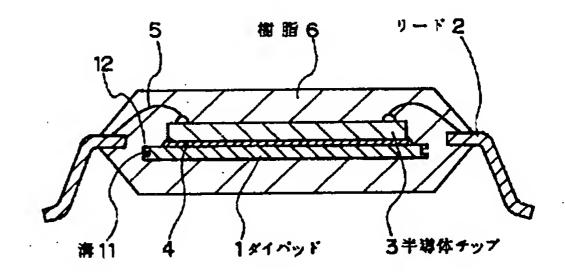
(51) Int.Cl. ⁵		識別記号		庁内整理番号	FI	技術表示箇所
HO1L 2		映かiic ウ U		9272-4M		
MVID (G			23/12 審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)
•					H01L	
·						
(21)出願番号		特颐平4-286243		(71)出願人	000116024 ローム株式会社	
(22)出願日		平成4年(1992)10月23日				京都府京都市右京区西院滯崎町21番地
						京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株
						式会社内
					(74)代理人	弁理士 朝日奈 宗太 (外2名)
	•	•				

(54) 【発明の名称】 半導体装置

(57)【要約】

【目的】 ダイパッドに半導体チップをダイポンディングして樹脂で封入した半導体装置で、ダイパッドと樹脂との剥離がとくに生じ易いダイパッドのコーナー部での密着性を改良し、連鎖的に発生する樹脂の剥離およびクラックの発生を防止する半導体装置を提供する。

【構成】 ダイバッド1の側壁に凹部11または凸部またはこれらの組み合わせを形成し、凹部11に樹脂6を喰い込ませたり、凸部を完全に樹脂で被覆すると共に、ダイバッドの薄い突出部12を樹脂で覆うことにより熱膨張率の差の影響を小さくして密着性を向上させる。



【特許請求の範囲】

ŧ

【請求項1】 ダイパッドに半導体チップがダイポンデ ィングされ、酸半導体チップおよびその周囲のワイヤポ ンディング部が樹脂で封入されてなる半導体装置であっ て、前記ダイバッドの側面に凹部および/または凸部が 形成されてなる半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体装置に関する。さ らに詳しくは、半導体チップを内部に封入した樹脂の剥 10 離やクラックを防止した半導体装置に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体装置は、通常半導体チップをダイ ポンディングするダイバッドの周囲に放射状にリードが 配設されたリードフレームに、ダイボンディングおよび ワイヤボンディングがされ、その周囲を樹脂で封入して 各リードを切断分離し、フォーミングすることにより形 成されている。

【0003】 このリードフレームはFe- Ni系の42合 金や銅の薄板材で形成され、樹脂はエポキシ樹脂などで 20 構成されている。この両者は異質の材料であり、熟膨張 係数も異なるが、材料コスト、作業性などの点から従来 よりこれらの材料で封入の条件などにより、樹脂の密着 性の改良がなされている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、封入の条件だ けではリードフレームの材質と樹脂の材質が異なるた め、途中工程または使用時の温度サイクルなどにより剥 離が生じ易く、信頼性に欠けるという問題がある。とく にダイパッドのコーナー部で剥離が生じ、樹脂の吸湿性 30 により外部から吸収した水分がダイバッドと樹脂のあい だの僅かの隙間に入り込み、温度上昇により隙間に入り 込んだ水分が蒸気となり膨張してさらに隙間を大きく し、ついには樹脂にクラックが発生するという問題があ る.

【0005】本発明はこのような状況に鑑み、水分の入 り込む余地をなくするように、とくにダイバッドのコー ナー部での樹脂との密着性を改良し樹脂のクラックを防 止した半導体装置を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明による半導体装置 は、ダイパッドに半導体チップがダイボンディングさ れ、該半導体チップおよびその周囲のワイヤボンディン グ部が樹脂で封入されてなる半導体装置であって、前記 ダイパッドの側面に凹部および/または凸部が形成され てなることを特徴とするものである。

[0007]

【作用】本発明によれば、ダイバッドの側面に凹部およ び/または凸部が形成されているため、樹脂との接着面 んだり、凸部を抱え込むように覆っているため、樹脂の 剥れが生じにくくなる。また凹部や凸部の形成により樹 脂で覆われる部分のダイバッドの側面は一層肉厚が薄く なっているため、相互に剥離しようとする力が働きにく く、一層樹脂の剥れが生じにくくなる。

【0008】その結果、コーナー部での密着性が維持さ れ、僅かの剥れも生じないので、樹脂が外部から吸収し た水分が拡散する余地がなく、従来品のごとく一部の剥 れが段々大きくなるという悪循環もなく、樹脂のクラッ クにも至らなくなる。

[0009]

【実施例】つぎに、図面を参照しながら本発明について 説明する。図1は本発明の一実施例である半導体装置の 断面説明図である。同図において、ダイバッド 1 および その周囲に放射状に配置されたリード2からなるリード フレームのダイバッド1に半導体チップ3をAu-Si などの導電性接着剤であるプリフォーム材4でダイボン ディングし、さらに金線5で半導体チップのダイパッド とリード2とをワイヤポンディングし、ポンディング部 分を封入のため、樹脂6でモールドし各リードをリード フレームから切り離して半導体装置が形成されている。 本発明は、リードフレームの状態でダイパッド1の側壁 に凹部である滯11が形成されているところに特徴があ る。

【0010】この灣11はパンチングまたはエッチングに よりダイパッド1および各リード2を形成したリードフ レームの状態で横方向エッチングをすることにより形成 する。具体的には、このリードフレームを形成するの に、まず必要なダイバッド1の大きさおよびリード2の 配置を決め、金型でたとえば、Fe-Ni系42合金板を 打ち抜き通常のリードフレーム形状に形成する。つぎに ダイパッド1の露出した側壁に溝を形成するためのパタ ーンマスクを形成し、エッチングする。また溝11の厚さ 方向に対する位置はダイバッド1の厚さの中心部に形成 されることが望ましいが、薄いダイパッド1の側面に正 確なパターンを形成するのは困難であり、また溝11内に 樹脂を喰込ませ、薄い肉厚部分を樹脂で被覆して樹脂剥 れを防止するのが目的であるため、板厚の中心部でなく ても、溝が形成できればよい。

【0011】この溝11はダイパッド1の側壁の周囲全体 に形成することが望ましいが、従来ではとくに角部での 樹脂剥離が生じ易かったことを鑑みれば、そのような樹 脂剥離の生じ易い部分に部分的に形成しても大いに効果 を生じる。この溝11が形成されていると、樹脂でダイバ ッド1部を封入するときに、樹脂がこの滯11内に流れ込 み、ダイパッド1と樹脂6とが完全に嵌合し、しかもそ の部分のダイバッド部分の肉厚は一層薄くなっているた め、熱膨强や収縮も小さく、また熱膨張率の差に基づく 剥離しようとする力は一層薄くなった凸状部分12で吸収 積が増大すると共に樹脂がダイパッド側面の凹部に喰込 50 され、剥離しようとする力が生じにくい。そのため最も

3

樹脂の剥離の生じ易いダイバッド1の端部での剥離が防止でき、ダイバッド端部での剥離が起点となりダイバッド裏面などに剥離が広がり、水分が拡散して一層剥離を助長するという悪循環を防止できる。

【0012】図2~4に本発明の他の実施例であるダイパッド1の側面の他の形状を部分拡大図で示してある。図2の形状は前述の例の溝11が凹溝であったのに対し、V溝13に構成したもので、このような形状でも前述と同様の効果を生じる。このばあいV溝をできるだけ深く形成した方が樹脂とかみ合うダイバッド1の部分が薄くなって、前述のように剥離しようとする力を弱くする効果がある。このV溝を形成するのはダイバッドを上下から挟んでおいて横方向からV字型の治具を押圧することにより簡単に形成できる。

【0013】また、図3の実施例は前述の溝でなく突起状の凸部14を形成したもので、ダイバッド1の端部の表面および裏面をエッチング除去し、中心部だけ残すことによって形成することもできるし、またパンチングでリードフレームを形成するときに端部を金型で押しつぶすことにより、圧延して形成することもできる。

【0014】このようにして形成された凸部14が、樹脂で完全に覆われ、また凸部14が薄いリードフレーム材のさらに半分以下の薄さであれば、剥離しようとする力が殆ど働かないため、前述の実施例と同様に樹脂との密着性を維持することができる。このばあい凸部14の長さりはできるだけ長く、たとえば0.4 mm程度以上にする方が効果的である。

【0015】この凸部14はダイバッド1の厚さの中心部に形成されるのが対称の観点からも好ましいが、もともとダイバッドの厚さはそれ程厚くないため、必ずしも厚 30 さの中心部に凸部14が形成されなくても、図4に示すようにダイバッド1の表面側または逆に裏面側に形成されてもよい。このばあいの凸部14は、前述と同様にエッチングにより形成するか、またはプレス加工で端部を圧延することにより形成することができる。

【0016】以上説明した実施例では、ダイバッドの側面に凹部または凸部を形成する例で説明したが、板厚に

余裕があればこれらを適宜組み合わせ、樹脂で覆われる 部分の突出部ができるだけ薄く形成されるのが、前述の ように剥離しようとする力を抑制し、密着性を向上させ る。

[0017]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、ダイバッド周囲の側壁に溝および/または凸部を形成して樹脂の喰い込みまたは被覆を完全に行うと共に、ダイバッド側の肉厚を薄くして剥離する力が生じないようにしているため、ダイバッド周囲での密着性が向上し、コーナー部での樹脂の剥離が生じない。その結果、コーナー部の剥離に起因してダイバッド裏面での樹脂の剥離、さらには樹脂のクラックと進展する不具合を完全に防止できる。

【0018】また一旦どこかに剥離が生じると樹脂で吸収した水分がその剥離部分に拡散し、熱により蒸気となってさらに剥離箇所を広げるが、一番剥離し易いダイバッドの周縁部での剥離を本発明により防止できるため、ダイバッド部と樹脂との密着性は維持され、全然剥離が20 生じず、内部への水分侵入も防止でき、信頼性を大幅に向上することができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例である半導体装置の断面構造の説明図である。

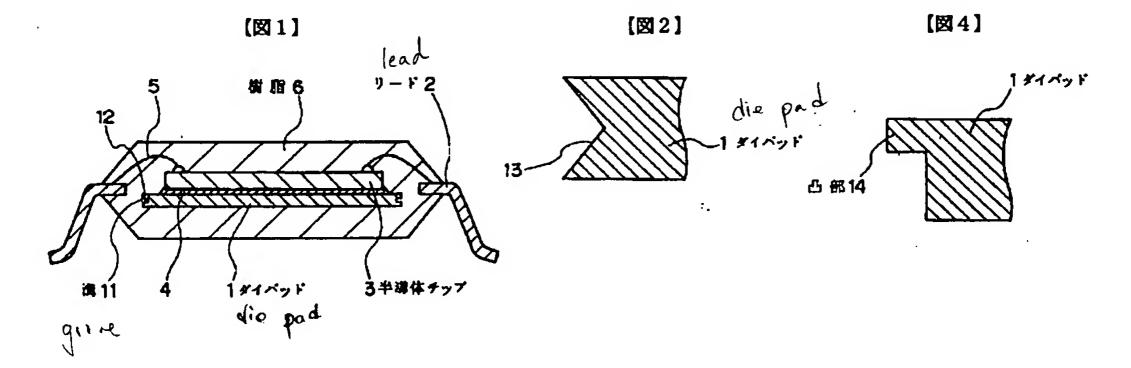
【図2】本発明の他の実施例である半導体装置のダイパッドの側面部の拡大説明図である。

【図3】本発明の更に他の実施例である半導体装置のダイバッドの側面部の拡大説明図である。

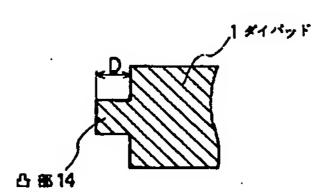
【図4】本発明の更に他の実施例である半導体装置のダイバッドの側面部の拡大説明図である。

【符号の説明】

- 1 ダイバッド
- 2 リード
- 3 半導体チップ
- 6 樹脂
- 11 溝
- 14 凸部







Abstract of Japanese Patent Office Gazette

No. H1-251747

SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

Inventor:

Nakazawa Tsutomu, et al.

Applicant:

Toshiba Corp.

Filed:

Mar. 31, 1988

Disclosed:

Oct. 6, 1989

PURPOSE: To prevent cracks from being produced in a molding resin even in working environment where heat acts by a method wherein upper and lower edges in a periphery of a bed and upper and lower edges at a connection end to a bonding wire of a lead are formed in such a way that their cross sections are of protruding arc shapes.

CONSTITUTION: This device includes the following: a semiconductor pellet 1; a bed 2 which has a required thickness for mounting this semiconductor pellet; a lead 3 which connects an element inside the semiconductor pellet 1 to the outside. The lead 3 is connected electrically to the semiconductor pellet 1 by using a bonding wire 4. When sharp parts 2a are formed at an upper edge and a lower edge in a peripheral part of the bed 2, a crack 5a is stretched from the sharp parts 2a when heat is applied during a mounting operation. Parts 20, 30 whose cross sections are protruding arc shapes are formed in parts where the sharp parts existed in a conventional method. By this setup, it is possible to completing restrain a crack from being produced in a region which has been regarded as safe in the conventional method.